

C205

광대역 플라즈마 광학 패턴 웨이퍼 검사 시스템은 반도체 칩의 수율과 신뢰성에 영향을 주는 결함을 발견합니다.

혜택 :

C205는 고감도 검출 및 치명적인 결함의 분류를 제공하여 자동차 반도체 칩 제조업체를 지원합니다.

- 새로운 공정, 설계 노드, 소자의 특성 부여 및 최적화를 통해 R&D와 양산 주기를 가속화합니다.
- 반도체 칩 품질 요구 사항을 충족하기 위해 결함 감소 전략을 실행합니다.
- 신뢰성 결함에 대한 정확하고 실행 가능한 데이터를 제공하여 다이 오버킬을 감소시킵니다.
- 검출이 누락될 수 있는 잠재 결함까지 검출하고 특성화 합니다.

기술 :

- 조정 가능한 DUV, UV, 가시광 광대역 입사 광원
- 선택 가능한 광학 조리개
- 저잡음 센서
- NanoPoint™ 기술
- 고급 결함 검출 알고리즘
- 결함 분류 자동화

응용 :

- R&D 및 양산에 대한 체계적인 결함 검출
- 공정 윈도우 검증
- 지속적인 개선을 위한 공정 변경 검증
- 고감도가 요구되는 중대한 층에 대한 인라인 모니터링

시장 :

자동차, IoT, 5G, 가전 제품, 산업(군사, 항공 우주, 의료)용 더 큰 설계 노드 소자에 들어가는 반도체 칩 제조

플랫폼 :

- 맞춤형 구성
- 확장 가능
- 업그레이드 가능

웨이퍼 크기 :

- 300mm
- 200mm



추가 정보: www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-c205